

RBXG-800-200-12D5-1R-15

五轴精密运动台

定制系统



产品特点

- 行程800mm*200mm*12.5mm*1° *15mm (XYZCEpin)
- 直驱结构，高精度
- 结构紧凑，降低测试点高度
- 优化线缆管理系统
- 结构、行程可定制

应用领域

RBXG-800-200-12D5-1R-15 五轴精密运动台用于晶圆加工、测量。

产品简介

XY 轴采用双直线电机驱动，滑块滚柱导轨导向及光栅尺闭环反馈，XY 轴为双驱龙门结构，行程 800mmx200mm。

Z 轴采用力矩电机驱动，交叉滚柱导轨导向及双光栅尺闭环反馈，平升 Z 轴结构，行程 12.5mm。

C 轴采用力矩电机驱动，精密轴环导向及光栅尺闭环反馈，行程 1°用于角度位置调整。

Epin 采用音圈电机驱动，光栅尺闭环反馈，用于晶圆切换。

ZC 轴内置 XY 轴中，结构紧凑，有效降低工作点的高度，降低阿贝误差对系统精度的影响，应用于晶圆加工及检测等领域。

大理石机体因强度大、硬度高、不生锈、耐腐蚀性、耐磨性及稳定性好，应用于运动台上质量可靠，品质有保障。大理石做模态分析，优化结构尺寸，可依据客户的要求做最终设计。

规格指标

轴系	测试项目	单位	指标要求	实测指标
X 龙门轴	行程	mm	800	800
	补偿后定位精度	μm	±2	±0.45
	单向重复定位精度	μm	±0.5	±0.2
	直线度	μm	±4	±0.55
	平面度	μm	±3	±0.85
	俯仰	arc sec	±5	±1.95
	偏摆	arc sec	±4.5	±1.4
	微动步距	nm	50	50
	工作速度	mm/s	50	50
Y 轴	行程	mm	200	200
	补偿后定位精度	μm	±1	±0.1
	单向重复定位精度	μm	±0.5	±0.05
	直线度	μm	±1	±0.65
	平面度	μm	±2	±0.95
	Pitch	arc sec	±5	±3.1
	Yaw	arc sec	±4.5	±0.8
	微动步距	nm	50	50
	工作速度	mm/s	50	50
Z 轴	行程	mm	12.5	12.5
	补偿后定位精度	μm	±0.5	±0.1
	单向重复定位精度	μm	±0.1	±0.05
	微动步距	nm	100	100
	工作速度	mm/s	8	8
C 轴	行程	°	1	1
	单向重复定位精度	°	±0.003	±0.0007
	微动步距	°	0.001	0.001
	工作速度	°/s	1	1
Epin	行程	mm	15	15
	单向重复定位精度	μm	±0.5	±0.2
XY	正交	arc sec	10	1
—	负载	kg	3	3